# ATF2 (ATF Final Focus Test) 1~2月の報告



- 1. 物理学会での講演のあらまし。
- 2. 前回(2012年12月)の推進委員会からの進捗。

# 物理学会での講演のあらまし。

### ATF (Accelerator Test Facility)

#### ILCの衝突点でビームを絞るための技術開発を進める施設



### ATF2 Phase 1

#### ILCの焦点におけるビーム収束技術の開発



どのように収差を抑えるかが大きな課題となる。 その為には、ビーム光学系(レンズ系)が重要!

#### **Global Chromaticity Correction**



ビームライン全体で収差の補正をするので、Global Correctionと呼ぶ。



- 1. エネルギーの違う粒子が最終収束電磁石 を通過するとき軌道差を付ける。
- 2. 電磁石の近くに、軌道差があると収束力に 差が出る電磁石(6極電磁石)を置く。
- 3. 最終収束電磁石のエネルギーの違いによる 収束力の差を6極電磁石で補正する。

収差が大きい電磁石の近くで補正をするので、Local Correctionと呼ぶ。



**Compact** 

•

### **Global & Local Chromaticity Correction**

### Global Correction と Local Correction の性能の例



### ATF2 Beam Line

•Same requirement of the magnet alignment and stability to the ILC FF

•Same strength of the chromaticity to the ILC FF

•Same magnet tolerances to the ILC BDS

•Same beam tuning method to the ILC FF



# ILCとATF2の線形磁場の影響の比較

#### **Strength Error** Field strength error giving 2% effect on beam size $10^{2}$ 10 O ILC # ATF2 0<sup>0</sup> 0 10<sup>1</sup> 0 10 (O ¥¥ 10<sup>-7</sup> C 0 00 00 0 10 0 10 0 10 0065 004 004 004 82 82 8 553 a a Magnet tilt error giving 2% effect on beam size 10<sup>3</sup> 10 Ó O ILC # ATF2 10<sup>3</sup> $10^{2}$ 0 microradian $\Delta$ Y micron 101 0 10 $\Delta$ tilt , O @ 10 10<sup>0</sup> 0 0 ðð 10<sup>0</sup> ð 10 QM16 QM15 QM14 QM13 QM12 QM12 QD10 QD10 0028 0077 0075 0075 0075 0074 0074 0073 0073 0073 0071 0071 0071 0071 B **Rotation Error**

Vibration



線形磁場の影響を考えると、電磁石への要求はILCとATF2は同等である。

### 非線形磁場の影響

ATF2はエネルギーが低いため、ILCよりも非線形磁場の影響を受けやすい。

高次の非線形磁場の影響を軽くするため、 現在ATF2では焦点での水平方向のビームサイズを大きくして運転している。

		ILC	ATF2(Design)	ATF2(現在)	
線形	αγ	1	1	1	
	ηy	1	1	1	
	<x y=""></x>	1	1	3.3	
	<x'y></x'y>	1	1	0.33	
2次	T346	1	1	1	色収差
	T324	1	7	2.3	6極電磁石を使うことで
	T322	1	7	0.7	・生しる磁场の影響
	T326	1	1	0.33	
	T366	1	1	1	
	T344	1	7	7	
3次(水平)		1	49	1.8	
4次(水平)		1	343	4.1	青井丁の以上で
5次(水平)		1	2401	9.4	電磁石の形状で 大きくなりうる磁場の影響

# 線形オプティクスの調整

ATF2の線形オプティクスの補正方法は基本的にILCと同じ。

最終収束光学系にある色収差補正用の6極電磁石の位置を"適切な比"で動かすことによって

〇ビームウエストの位置 〇焦点におけるエネルギー分散 〇水平方向とのカップリング

だけを独立に動かすことが出来る(線形knob)。



線形オプティクスの調整の例

# レーザー干渉計を利用したビームサイズモニター

Collaboration with Univ. of Tokyo



# IPBSM 交差角と測定可能ビームサイズ



# 現在のATF2の状況

2013年3月の運転の状態をみて、内容は変わります。



現在、ATF2では約70nmのビームサイズが測定されている。

# FFTBとATF2の測定結果の比較

	FFTB		AT	F <b>2</b>
	Design	Result	Design	Result
<b>Correction Method</b>	Global Chromaticity Correction		Local Chromatio	city Correction
Beam Energy	46.6 GeV		1.28 GeV	
L*	0.40	) m	1.00 m	
σp/p	0.30 %	0.05 %	0.08 %	0.06%
βx* × βy*	10mm × 0.1mm	10mm × 0.1mm	4mm × 0.1mm	40mm × 0.1mm
εх × εγ	0.33nm × 33pm	0.33nm × 20pm	2.0nm × 12pm	2.0nm × 20pm
σy* (linear)	57nm	70nm (45nm)	35nm	70nm (45nm)
L*/βy* × σp/p	12	2	8	6
を加挙の治との指摘				

色収差の強さの指標

FFTBとATF2双方で線形光学系では45nmを期待されるところ70nmのビームサイズが測定された。 FFTB, ATF2共に、デザインのパラメータよりも易しい条件で測定されている。 光学系の色収差の厳しさを比較すると、ATF2の方がFFTBよりも3倍厳しい条件である。

### 現在のATF2のビーム光学系の問題

水平方向のベータ関数がデザインよりも10倍大きい。

- <x'y> や T326など一部の高次磁場の影響がILCの最終収束系よりも少ない。
- ・2013年春までの運転は、このビーム光学系を使う。

垂直方向ビームエミッタンスがデザインよりも大きい。

- ダンピングリング内のエミッタンスはデザイン値(12pm)まで小さくなっている。
- ダンピングリングから取り出すとエミッタンスが増える。

焦点でのビーム強度依存性が大きいため、低電流での測定になっている。



# Wakeの影響をILCと比較

Evaluated by K.Kubo (15<sup>th</sup> ATF2 Project Meeting)

アライメントへの影響			ジッターへの影響		
	ILC	ATF2	ILC ATF2		
1/E_beam (1/GeV)	1/250	1/1.3	1/E_beam (1/GeV) 1/250 1/1.3		
Effect of bunch length	0.3 ?	1	Effect of bunch length0.3 ?1		
$1/\sqrt{arepsilon_{\mathcal{Y}}}$ (m^(-1/2))	$1/\sqrt{8 \times 10^{-14}}$	$1/\sqrt{1.2 \times 10^{-11}}$	$\sum_{\text{Q-mag.}} \beta_y$ (m) 350,000 63,000		
$\sum_{\text{O-mag.}} \sqrt{eta_y}$ (m^(1/2))	3,000	1,000	Total (Relative to ATF) 0.0087 ? 1		
Total (Relative to ATF) 0.057 ? 1		1	ILC の Cavity BPM の影響はATF2より弱い。		

Resistive Wallの場合

### Cavity BPMの場合

アライメントへの影響

ILC ATF2 1/E\_beam (1/GeV) 1/1.3 1/250 Effect of bunch length 20? 1  $1/\sqrt{\varepsilon_y}$  (m^(-1/2))  $1/\sqrt{8 \times 10^{-14}}$   $1/\sqrt{1.2 \times 10^{-11}}$  $\int ds \sqrt{\beta_y}$  (m^(3/2)) 89,000 4,000 Total (Relative to ATF) 28? 1

	ILC	ATF2
1/E_beam (1/GeV)	1/250	1/1.3
Effect of bunch length	20 ?	1
$\int ds eta_y$ (m^2)	8,900,000	1,100,000
Total (Relative to ATF)	0.84 ?	1

ILCの Resistive Wallの影響はATF2より強い。

### ATF2 Phase 2

#### 衝突点でビームの位置を制御するための研究

ATFでは、現在、Phase 1の研究と並行して、Phase 2のための準備を進めている。

New IP-BSM Chamber made in LAL, France



LALで新しいIP-BSM用のチェンバーを作っている。
O IP-BSM の測定と共存できる。
O チェンバーにはIP-BPM 3台が付いている。
O それぞれのIP-BPMはピエゾムーバーが付いている。

Phase2用のIP-BPMは2013年6月にインストールする。 (このための話し合いを現在LALでおこなっています。)





Collaboration with KNU

• Made by Aluminum (2kg for double block)



インストール予定のBPMブロックはATF Linac で予備試験をおこなった。

# Intra-train高速フィードバックの開発

Collaboration with Oxford University

全く違った加速器から作られたビーム同士を衝突させるために必要な技術



ATFでは、2-3バンチのビームを使って、Intra-trainフィードバックの技術を研究する。



今後の予定

短期の予定

正式にはまだ決まっていないが、5月にATF2のみに特化した連続運転が入る公算が高い。 学会までには予定が固まると思う。

現在、LALにて、Phase2用チェンバーのインストールの予定を話し合っている。 これも学会までには予定が決まると思う。



長期の予定

学会までに関係者と話し合って、その結果を踏まえて発表する。

# 2012年12月の推進委員会からの進捗

ATF2 Project Meeting で決まった今後の進め方
6極電磁石の入れ替えと、その影響。
Wake の影響 (前回推進会議からの進捗)

# ATF2 Project Meeting で決まった今後の進め方

ATF2 Project Meeting は、年2回(1回はKEK,もう一回は海外が基本)開催されている。 前回の推進会議以降、1/23 - 1/25 の3日間、KEK で第15回ATF2 Project Meeting をおこなった。

#### 現在のATF2のビーム光学系の問題

水平方向のベータ関数がデザインよりも10倍大きい。 垂直方向ビームエミッタンスがデザインよりも大きい。 特に、ダンピングリングから取り出す際のエミッタンス増大が強い。 焦点でのビーム強度依存性が大きいため、低電流での測定になっている。

#### 今後、数か月のATF2の進め方

- 1. 10×1光学系で、N=0.1e10の低電流運転で出来るだけ小さいビームに絞る。
- 2. 取り出しビームのエミッタンス増大の問題、wakeの問題は、 ハードウエアの改造が伴う可能性があるので、可能になったら随時おこなっていく。
- 3. 2013年5月に連続運転をする可能性を精査する。

# DR内と取り出した後のエミッタンス



取り出した後の方がエミッタンスが大きく、ビーム強度依存性も強い。

ダンピングリングから取り出す際のエミッタンス増大を抑えないと、 ATF2でデザインビームサイズまで絞ることはできない。

# 6極電磁石の入れ替えと、その影響

2012年12月の運転におけるNonlinear knobの効果



- 12/19 ; 174度モードでの最初の測定をおこなった。 明らかなモジュレーションは観測されなかった。
- 12/20 ; 174度モードでの2度目の測定をおこなった。 モジュレーションが観測された。

この2日間での明らかな違いはNonlinear knob のパラメータだった。

12/19 ; Y22=-0.6, Y26= 0.0, Y44= 0.0 12/20 ; Y22=-0.2, Y26=-0.2, Y44= 0.0

# Skew 6極電磁石を使ったビームサイズ調整 (2012年10月の推進委員会で報告)



SK1FF ; sensitive to T322, T326, T366 SK2FF ; sensitive to T344 SK3FF ; sensitive to T322, T326, T366 SK4FF ; sensitive to T322

> T322, T326, T366, T344 knobs are calculated by the combination of SK1FF, SK2FF, SK3FF, SK4FF.

#### 2012年12月の運転では、Skew6極磁場の補正を大きくかけなければ、 ビームサイズは小さく絞れなかった。





#### 6極電磁石を磁場中心にセットして6極電磁石の電源を入れると、 焦点でのビームサイズが大きくなる。

磁場中心を求める測定例(BBA)



#### FF sextupoles turned off



#### FF sextupoles turned on with BBA offset

500

P0 = -2.9300 +/- 1.45E-4

1000



#### Vertical beam size

Sexts OFF 2.4um Sexts ON 4.5um

6極電磁石が変ではないか??

6極電磁石のインピーダンス測定



# The effect of the small current of pole5 for SD4FF



When the current of pole5 was smaller than those of others,

- -Generate the horizontal kick
- -Generate the skew quadrupole field
- -Reduce the sextupole field
- -Generate the higher multipole fields.

エミッタンスのビーム強度依存性との組み合わせで、 IPビームサイズのビーム強度依存性に影響?

### The effect of the skew quadrupole field of SD4FF

- -Generate the vertical dispersion ( can be corrected with Ey knob )
- -Generate the <x'y> ( can be corrected with Coup2 knob )
- -Converted T122 from SF6FF to the IP vertical beam size
  - -> generate T322
  - -> almost same effect to the roll of SF6FF

# インピーダンス測定を踏まえたシミュレーション



- emitx=2nm, emity=12pm

- put K1S= -0.015 at SD4FF

- rotate the SK4FF by -44.4 deg.

The IP vertical beam was 3.5um by effect of <x'y> and  $\eta$ y\* for skew quad of SD4FF.

The beam size was smaller by applying the linear knob tuning

3.5um -> 100nm

	rms beam size	core beam size	
No errors	55.4nm	51.7nm	
With errors, linear knob	111.1nm	101.5nm	
Y22=-0.6, Y26= 0.0	96.4nm	91.1nm	12/19 setting
Y22=-0.2, Y26=-0.2	71.1nm	67.0nm	12/20 setting

There is a clear difference between the setting of 12/19 and 12/20.

The estimated beam size on 12/20 setting was smaller than that of no correction, but larger than that for no multipole errors.

# インピーダンス測定を踏まえたシミュレーション2



- put K1S= -0.015 at SD4FF
- rotate the SK4FF by -44.4 deg.
- optimize the linear knobs (Ay, Ey, Coup2)
- evaluate the nonlinear knob response

# 6極電磁石の入れ替え

現在の設定では、SF5FFの磁場は弱いため(SF5FFは1A, SD4FFは27A)、 2013年1月の運転前に、SD4FFとSF5FFを入れ替えた。

# 入れ替え前後のBBA結果

#### 2012/11/08 (入れ替え前)

#### FF sextupoles turned off



#### FF sextupoles turned on with BBA offset



#### Vertical beam size

Sexts OFF	2.4um
Sexts ON	4.5um

#### 2013/02/06 (入れ替え後)



#### FF sextupoles turned off

#### FF sextupoles turned on with BBA offset 14:45:59 finish 796.0V ICT Correction OF tensitu selection OFF 1.50 +/-0.50 ADC raw 1585.0 Gamma 1585.00 Horizontal Beam Size Measuremen ICT 0.29 START SCAN STOP Naverage 5820.10 IP-85M Delector SERTE Fitting Results (Gauss+Linear) BG monitor CHISOR 2.3522E+04 Open the Window BG Monitor Control Stage Peak 16.083 +- 0.000 m Wire Peak 9.790 +- 0.000 mm Sigma 12.633 + 0.002 fre Position (0~100n 1362.60 al databata bata bata micro 16.00 16.02 16.04 16.05 16.08 16.10 16.12 16.14 16.16 16.18 16.20 LIMIT OFF 16.00 step 0.005mm 16.20 13,835 Ahite: 175.007 Read: Vartical Ream Size Measuren Read from IPMove START SCAN STOP Naverage 10076.00 13.835 **Read Position** Fitting Results (Gauss+Linear) Go Stay Position CHISQR 1.7332E+05 Stage Peak 13.023 + 0.000 mm Wire Peak 10.966 +- 0.000 mm Laser Attenuator & Gamma shutter have to be inserted Sigma 2,296 +- 0.000 1386.00 micro 13.81 13.83 13.81 step 0.001mm 13.84 SAVE RESULTS

#### Vartical baam aiz

Vertical beam size

Sexts OFF 2.5um Sexts On 2.3um

# 入れ替え前後のNonlinear knobの応答

#### 2012/12/20 (入れ替え前)



2012年12月と違い、強いskew6極磁場をかけないでも、30度モードでモジュレーションが大きくなった。

# 入れ替え前後のビーム強度依存性の変化

2012/12/21

2013/02/07



ATF2 IP での強度依存性は2012年12月より減少しているが、まだ存在する。 強度依存性が減少した原因はSD4FFの高次磁場の影響か??

# Wake の影響 (前回推進会議からの進捗)

#### 2012年12月のReference CavityのWakeの軌道解析

(前回推進会議では1つのBPMでの軌道変化を報告)



J.Snuverink, 15th ATF2 Project Meeting

# Reference Cavity の位置とIPのビームサイズ



オーダーはsimulationと測定は一致しているが、 測定値の方がSimulationよりも若干ビームサイズ依存性が強い。

# Summary

当面は10×1光学系で、N=0.1e10の低電流運転で出来るだけ小さいビームに絞る。

6極電磁石のコイルのインピーダンス測定の結果、 SD4FFの1つのコイルのインピーダンスが低いことがわかった。

SD4FFを磁場が弱いSF5FFと交換したところ、

- 6極電磁石を磁場中心に合わせてONした時もIPのビームサイズが変わらなくなった。
- Nonlinear knobを使わないでも、ビームサイズを絞れるようになった。
- ビーム強度依存性が弱くなった(要確認)。

Reference CavityのWakeの強さの解析、測定を進めた(現在進行中)。

- Wakeの強さをSimulationで解析すると0.21V/pC/mm(バンチ長の不定性あり)。
- ビームの軌道測定では0.3-0.4V/pC/mm

- IPのビームサイズの変化は測定では70nm/mmだった。

- Wakeの強さを0.4V/pC/mmとしたトラッキングでは53nm/mmだった。

IPビームサイズのビーム強度依存性の研究は今後も続けていく予定。

# Backup

### Emittance measurement after rematching



# 取り出しセプタムの非線形磁場



ATF2ビームラインのDispersionは、取り出しセプタムにskew4極磁場があると説明できる。 推定されるSkew4極電磁石の強さは、取り出しキッカーの強さで変化する。 これらから、取り出しセプタムにはskew6極磁場があるのではないかと考えられる。

### 垂直方向への軌道の漏れ

取り出しラインの水平方向の軌道が変わらないようにキッカー、セプタムの強さを調整すると、 垂直方向に軌道が変わる。

この軌道は、取り出しキッカーが大きく回転していると考えると理解できる。

#### Kicker & Septum Orbit Data

In order to make same EXT orbit, we must set to the following Septum and vertical steering settings

KEX	BS1X	BS3X	ZV1X	ZV2X
46000	1545.49A	2576.02A	-0.391A	-0.062A
48000	1534.29A	2584.62A	-0.181A	-0.112A
50000	1522.69A	2593.62A	+0.099A	-0.197A
44000	1555.29A	2568.42A	-0.601A	+0.003A
42000	1566.69A	2559.42A	-0.961A	+0.108A
40000	1577.49A	2551.52A	-1.241A	+0.183A





KEX(kV)

KEX(kV)

# 取り出しキッカー、セプタムのアライメント

取り出しキッカー、セプタムをアライメントの基準通りに並べると、 垂直方向に大きく軌道がでる。

補正するために、2010年4月にセプタムBS3Xを4mrad回転させた。

その後、BS3Xをもとに戻し、2012年1月に取り出しキッカーを60mrad回転させた。 現在は、この状態である。

# 入れ替え前後のReference Cavityの位置依存性

